

名古屋大学 未来材料・システム研究所 超高压電子顕微鏡施設 第1回ユーザーズミーティング

日時:平成29年3月7日(火) 13時00分~17時00分

場所:名古屋大学 環境学総合館 1階 レクチャーホール

趣旨

本学超高压電子顕微鏡施設は、2010年反応科学超高压走査透過電子顕微鏡の導入及び2011年文部科学省ナノテクノロジープラットホーム微細構造解析への参画を機に大きく生まれ変わりました。最先端の電子顕微鏡を幅広い分野のご研究に更に生かしていただくために、今回学内外のユーザーの方々を対象に施設の技術情報の公開及び施設スタッフとの交流を図る目的で第一回ユーザーズミーティングを企画いたしました。是非この機会を利用して皆様の施設へのご意見・ご要望などをいただければ幸いです。

プログラム

13:00 挨拶 未来材料・システム研究所 超高压電子顕微鏡施設 施設長 武藤俊介

13:10 特別講演①「In-Situ Electron Microscopy: Past, Present & Future」
Stephen Mick Ph.D / Gatan Product Manager

13:55 特別講演②「GATAN In Situ記録に最適化されたOne View,K2-IS ガタン高速CMOSカメラ」
日本ガタン 伊野家浩司

— 休憩 —

14:50 ユーザー講演 「透過型電子顕微鏡による低次元ナノ物質の構造解析」
理学研究科 北浦 良

15:30 ユーザー講演
「水素化反応における担持Auナノ粒子触媒のサイズ効果の原子スケール解析」
工学研究科 大山順也

16:10 「平成29年度に新たに導入予定の汎用S/TEMの機能紹介」
未来材料・システム研究所 超高压電子顕微鏡施設 施設長 武藤俊介

16:30 質疑応答 意見交換 施設への要望、質問など

超高圧電子顕微鏡施設ユーザーのみなさま

平素、大変お世話になっております、超高圧電子顕微鏡施設です。

平成29年3月7日(火)に名古屋大学 未来材料・システム研究所 超高圧電子顕微鏡施設第1回ユーザーズミーティングを開催します。

ミーティングでは、透過電子顕微鏡周辺機器の主要メーカーであるGatan社の講演、学内ユーザーによる講演、次年度導入予定の装置の紹介、施設への要望や意見交換を行います。

参加を希望される方は、3月1日(水)17:00までに、kenbikyo@imass.nagoya-u.ac.jp宛に、氏名、所属研究科・専攻、研究室名、職名(学生の場合は学年)をお知らせ下さい。

(当日参加も可能です。但し、事前に参加人数を把握したいため、可能な限りお申し込みをお願いします。)

よろしく願いいたします。

超高圧電子顕微鏡施設 施設長 武藤俊介

問い合わせ先
超高圧電子顕微鏡施設
TEL: 052-789-3631
E-mail: kenbikyo@imass.nagoya-u.ac.jp